PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-302506

(43) Date of publication of application: 02.11.1999

(51)Int.CI.

CO8L 63/00 CO8K 3/36 HO1L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 10-122805

(71)Applicant: TATSUMORI:KK

SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

16.04.1998

(72)Inventor: HIRANO TATSURO

SUZUKI NOBUKAZU SHIOBARA TOSHIO **AOKI TAKAYUKI** OSADA MASAKAZU

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTOR AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition including a highly packed inorganic filler, having readily controlled expansion coefficient and providing a hardened product having high thermal conductivity, low water absorption and high quality by including an epoxy resin, a hardener and an inorganic filler including a spherical cristobalite.

SOLUTION: This epoxy resin composition comprises (A) an epoxy resin (e.g. a resin of formula I [G is glycidyl; (n) is 1-10]], (B) a hardener {e.g. a resin of formula II [(n) is 0-10]} and (C) inorganic fillers compounding 1-90 wt.% spherical cristobalite obtained by forming a spherical fused silica having 0.3-50 "m average particle diameter and ≤150 "m maximum particle diameter into the cristobalite. The proportion of the used components A to B in the composition is preferably regulated so that the amount of the phenolic hydroxy group may be 0.5-1.6 mol per mol of the epoxy group, and the total amount of the used component C is preferably 300-1,200 pts.wt. based on 100 pts.wt. total of the components A and B.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.11.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-302506

(43)公開日 平成11年(1999)11月2日

(51) Int. Cl. 6	識別記 号		FΙ			
C 0 8 L	63/00		C 0 8 L	63/00	С	
C 0 8 K	3/36		C 0 8 K	3/36		
H01L	23/29		H 0 1 L	23/30	R	
	23/31				•	
	審査請求 未請求 請求項の数4	FD			(全11頁)	
(21)出願番号	特願平10−122805		(71)出願人	591138	038	
				株式会	社龍森	
(22)出願日	平成10年(1998)4月16日	ļ		東京都	港区芝公園2丁目9番3号	
		-	(71)出願人	000002	060	
		.		信越化	学工業株式会社	
				東京都	千代田区大手町二丁目6番1号	
			(72)発明者	平野	達郎	
				福島県	郡山市田村町上行合字南川田50	株
				式会社	龍森郡山工場内	
			(72)発明者	鈴木	伸和	
				福島県	郡山市田村町上行合字南川田50	株
				式会社	龍森郡山工場内	
			(74)代理人	、 弁理士	: 小島 隆司 (外1名)	
					最終頁に続	そく

(54) 【発明の名称】半導体封止用エポキシ樹脂組成物及び半導体装置

(57)【要約】

【解決手段】 エポキシ樹脂、硬化剤及び無機質充填剤を必須成分とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、無機質充填剤として球状クリストバライトを充填剤全体の1~90重量%配合してなることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【効果】 本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、無機質充填剤として球状クリストバライトを特定量配合することにより、無機質充填剤を高充填化し得、かつ膨張係数の制御を簡単に行うこともでき、高熱伝導化及び低吸水率で高品質の硬化物を与える。

10

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂、硬化剤及び無機質充填剤を必須成分とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、無機質充填剤として球状クリストバライトを充填剤全体の1~90重量%配合してなることを特徴とする 半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

1

【請求項2】 球状クリストバライトが、平均粒径0.3~50μmでかつ最大粒径150μm以下の球状溶融シリカのクリストバライト化物である請求項1記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項3】 無機質充填剤として、球状クリストバライトと球状溶融シリカとを併用してなる請求項1又は2 記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の半導体封止用 エポキシ樹脂組成物の硬化物で封止してなる半導体装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、無機質充填剤を高充填し得、かつ膨張係数の制御を簡単に行うことができ、高熱伝導性及び低吸水率の硬化物を与え、最先端の薄型パッケージ用封止剤等としても好適に使用することができる半導体封止用エポキシ樹脂組成物及びこの組成物の硬化物で封止された半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】最近の 薄型パッケージ用封止剤としてのエポキシ樹脂組成物に おいては、球状の溶融シリカを高充填化することで吸水 量を低減させ、基板にパッケージをハンダづけする際の クラックを防止している。しかし、このように溶融シリ カを高充填すると、膨張係数が非常に小さくなり、銅を リードフレーム材に使用した場合、リードフレームの膨 張係数とエポキシ樹脂組成物の膨張係数とが大きくかけ 離れてしまい、温度サイクルやリフロー時のストレスに より容易にクラックが入ってしまうという問題が生じ る。

【0003】このような問題の解決策として、溶融シリカに膨張係数の大きな無機質充填剤を混合することでエポキシ樹脂組成物の膨張係数を調整しようとする試みが古くから行われている。例えばエポキシ樹脂組成物中に、無機質充填剤として溶融シリカに結晶シリカを混合したものを配合することは数多くの特許に記載されている。

【0004】しかしながら、これらの特許に使用されている結晶シリカは、破砕状のもののみであることから、最近の球状溶融シリカを高充填した組成物のレベルまで結晶シリカを導入することができず、そのため吸水率を目標レベルまで低下させることができないという欠点があった。更に、結晶シリカは球状のものを工業的に製造することができないため、球状結晶シリカの入手が非常 50

に困難であり、かつ入手したとしても、天然品であって 河床に長年かかって摩碎されてできたものであることか ら、純度的にも最先端デバイスの封止用に使用すること は難しく、かつ高充填に最適な粒度分布を作ることは不 可能であった。

【0005】本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、無機質充填剤の高充填化が可能であり、かつ膨張係数の制御を簡単に行うことができ、高熱伝導性及び低吸水率の硬化物を与える半導体封止用エポキシ樹脂組成物及びこの組成物の硬化物で封止された半導体装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結 果、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機質充填剤を必須成分 とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、無機 質充填剤として球状クリストバライトを充填剤全体の1 ~90重量%配合することにより、無機質充填剤を高充 填し得る上、膨張係数の制御を簡単に行うことができ、 高熱伝導性及び低吸水率の硬化物を与える半導体封止用 エポキシ樹脂組成物が得られることを見出した。

【0007】この場合、本発明者は、最適な粒度に調整された球状溶融シリカをクリストバライト化することで、球状溶融シリカがその形状及び粒度分布を維持したまま溶融状態からクリストバライトに結晶化し得、粒度分布と形状を変えることなく高充填化、高熱伝導化及び膨張係数の制御が可能な球状クリストバライトを得ることができ、更にこのようにして得られる球状クリストバライトをエポキシ樹脂組成物の充填剤として特定割合で配合した場合、フィラーの高充填化が可能で、高熱伝導化し得るばかりか、膨張係数を自由に調整して低吸水率化できることを知見し、本発明をなすに至ったものである

【0008】従って、本発明は、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機質充填剤を必須成分とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、無機質充填剤として球状クリストバライトを充填剤全体の1~90重量%配合してなることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物及びこの半導体封止用エポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装置を提供する。

【0009】以下、本発明について詳細に説明すると、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、無機質充填剤を必須成分としてなるものである。

【0010】本発明で使用するエポキシ樹脂としては、 従来から公知の一分子あたり2個以上のエポキシ基を持ったものであればいかなるものでも使用することができる。特にビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールP型エポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール

ノボラック型エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹 脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、トリフェノールアルカ ン型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、フェノ ールアラルキル型エポキシ樹脂、シクロペンタジエン型 エポキシ樹脂などが例示される。これらエポキシ樹脂の* *中でも下記構造式で示される液晶構造を有するものが望 ましい。

[0011] 【化1】

$$OG$$
 CH_2
 CH_2
 H

$$\begin{array}{c} \text{Me} \\ \text{GO} \\ \text{Me} \end{array} \begin{array}{c} \text{Me} \\ \text{OG} \\ \text{Me} \end{array}$$

$$CH_2$$
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2

$$CH_{2} \xrightarrow{OG} CH_{2} \xrightarrow{CH_{2}} CH_{2} \xrightarrow{CH_{2}} CH_{2}$$

$$(R')_{4} GO$$

$$(R')_{5}$$

$$\begin{array}{c|c}
Me & Me \\
GO & -C - C - C - C \\
Me & Me
\end{array}$$

G=グリシジル基、Me=メチル基、nは1~10の整数

(上記式中、R¹は互いに同一又は異種の水素原子、炭 素数1~4のアルキル基及びフェニル基から選択される 基である。)

【0012】これらエポキシ樹脂中の全塩素含有量は1 500ppm以下、特に1000ppm以下であること が望ましい。また、120℃で50%エポキシ樹脂濃度 における20時間での抽出水塩素が5ppm以下である 50 脂、クレゾールノボラック樹脂等のノボラック型フェノ

ことが好ましい。全塩素含有量が1500ppmを超え たり、抽出水塩素が5 p p m を超えると、半導体の耐湿 信頼性が低下する場合がある。

【0013】本発明の硬化剤としては、1分子中にフェ ノール性の水酸基が2個以上あれば如何なるものでも使 用可能である。具体的には、フェノールノボラック樹

ール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、トリフェノール アルカン型樹脂、ナフタレン型フェノール樹脂、ビフェ ニル型樹脂、シクロペンタジエン型フェノール樹脂や下 記様体のフェノー世と動見を含有さるものなどが例示さ *れる。 【0014】 【化2】

nは0~10の整数

(上記式中、R²は互いに同一又は異種の水素原子、炭素数1~4のアルキル基及びフェニル基から選択される基である。)

【0015】上記フェノール樹脂もエポキシ樹脂同様、 120℃で抽出される塩素イオンやナトリウムイオンな どはいずれも10ppm以下、特に5ppm以下である ことが望ましい。

【0016】エポキシ樹脂とフェノール樹脂との使用割合は、エポキシ基1モルに対してフェノール性水酸基が0.5~1.6モル、特に0.6~1.4モルとなる範囲が好適である。フェノール性水酸基の割合が0.5モル未満では、水酸基が不足してエポキシ基の単独重合の割合が多くなり、ガラス転移温度が低くなる場合があり、1.6モルを超えるとフェノール性水酸基の比率が高くなり、反応性が低下する他、架橋密度が低く十分な強度が得られないものとなる場合がある。

【0017】更に、本発明では、硬化促進剤を配合する 50

ことが好ましい。硬化促進剤としては、トリフェニルホスフィンや、2,6-位、2,4,6-位がメトキシ基で置換されたトリフェニルホスフィンの誘導体或いはこれらの4級塩などの有機リン系化合物、イミダゾール誘導体、1,8-ジアザビシクロ(5.4.0)ウンデセン-7等のシクロアミジン系誘導体などを使用することができる。硬化促進剤の配合量は、エポキシ樹脂とフェノール樹脂の合計量100重量部に対して0.01~10重量部が好ましい。

【0018】本発明組成物は、無機質充填剤として球状 クリストバライトを配合することを特徴とするものであ る。

【0019】ここで、上記球状クリストバライトは、従来公知の製法で製造された球状溶融シリカのクリストラバイト化により得ることができるが、原料としての球状溶融シリカとしては、平均粒径が $0.3\sim50\mu$ m、特に $0.3\sim30\mu$ m、とりわけ $0.3\sim20\mu$ mで最大

粒径が 150μ m以下、特に 100μ m以下、とりわけ 75μ m以下のものが望ましい。平均粒径が 50μ mを 超えると、粒径が粗くなりすぎてゲートづまりや金型摩耗を引き起こしやすくなる場合があり、平均粒径が 0.3μ m未満では粒子が細かくなりすぎて多量に充填する ことができなくなる場合がある。また、最大粒径が 150μ mを超えると、粒径が粗くなりすぎてゲートづまり や金型摩耗を引き起こしやすくなる場合がある。なお、ここでの平均粒径は、例えばレーザー光回折法による粒度分布測定における重量平均(メジアン径)等として求 10めることができる。

7

【0020】また、球状溶融シリカは、不純物として含まれるアルカリ金属やハロゲン元素量がそれぞれ20ppm以下、特に10ppm以下であることが好ましい。いずれかの不純物量が20ppmを超える球状溶融シリカをクリストバライト化したものを充填剤として使用すると、耐湿性低下が生ずる場合がある。なお、上記アルカリ金属やハロゲン元素量は、具体的には、試料10gを250ccのプラスティック容器に入れ、純水100ccを加え、30分間振とう後、95℃の恒温槽で20時間放置し、次いで試料を分離した後の抽出水のアルカリ金属やハロゲン元素量をイオンクロマトグラフィーにより測定した値である。

【0021】更に、本発明では、原料の球状溶融シリカがその形状及び粒度分布を維持したまま溶融状態からクリストバライトに結晶化されるので、特に不純物としてウランやトリウムの含有量が非常に少ないもの、具体的にウラン、トリウム含有量が1ppb以下である高純度合成球状シリカを原料として用いると、メモリーデバイス用に好適な球状クリストバライトを得ることができる。

【0022】本発明では、このような球状溶融シリカを1200~1600℃、特に1200~1500℃の高温で10~50時間、特に15~40時間加熱し、結晶を確実に成長させた後、冷却することでクリストバライト化させることができる。なおこの場合、昇温速度は室温から所定の温度まで10~100℃/分が好適である。加熱温度が1200℃未満では完全にクリストバライト化するのに長時間要する場合があり、1500℃を超えると球状溶融シリカ粒子同士が融着し、元の粒度分布を維持しなくなる場合がある。また、加熱時間が10時間未満では結晶化が不十分となる場合があり、50時間未満では結晶化には十分な時間であるが、高温で長時間維持しなければならないことからコストアップを招いてしまう場合がある。

【0023】このようにして得られる球状クリストバライトは、原料の溶融シリカの形状、粒度分布をそのまま維持し得ることから、エポキシ樹脂組成物への充填量も高くすることができ、かつ熱伝導率も向上させることができる。更に、形状が球状であるため、高充填しても金50

型摩耗も非常に少ない組成物が得られる特徴がある。

【0024】上記球状クリストバライトは、予めシランカップリング剤、チタン系カップリング剤、アルミニウム系カップリング剤などのカップリング剤で表面を処理して使用してもよい。

【0025】本発明のエポキシ樹脂組成物には、無機質充填剤として上記の球状クリストバライト以外の無機質充填剤を配合することができる。他の無機質充填剤としては、例えばボールミルなどで粉砕した溶融シリカ、火炎溶融することで得られる球状シリカ、ゾルゲル法などで製造される球状シリカ、結晶シリカ、アルミナ、ボロンナイトライド、チッ化アルミ、チッ化珪素、マグネシア、マグネシウムシリケートなどが挙げられる。なお、エポキシ樹脂組成物に無機質充填剤を高充填するには、使用する充填剤全てが球状のものであることが望ましい。他の無機質充填剤としては、特に球状溶融シリカが好適である。

【0026】本発明においては、上記球状クリストバライトを全充填剤の1~90重量%、望ましくは5~70重量%、より望ましくは10~50重量%の範囲で配合する。球状クリストバライトの配合量が1重量%未満では、配合効果が発揮されず、本発明の目的を達成することができない。また、配合量が90重量%より多くなると、膨張係数が非常に大きくなり半導体素子に対する応力が大きくなる。特に、クリストバライトは200℃以上で膨張係数が大きくなるため、クリストバライトの充填量が90重量%より多いと、応力等の問題で不具合が発生する可能性が高い。

【0027】無機質充填剤の総使用量は、通常、エポキシ樹脂と硬化剤の総量100重量部に対して300~1200重量部、特に500~1000重量部、とりわけ600~1000重量部が好適である。無機質充填剤の使用量が300重量部未満では、膨張係数を十分に下げることができない上、吸水率も多くなり半田リフローの際の温度でパッケージにクラックが入ってしまう場合があり、1200重量部を超えると粘度が高くなりすぎて成形できなくなってしまう場合がある。

【0028】更に、本発明組成物には、チクソ性付与のためアエロジルなどの超微粒子シリカを添加することもできる。この種の超微粒子シリカを使用する場合は、予めボールミル等の混合装置を用いて他の充填剤と均一に混合した後、使用したほうがよい。

【0029】また、本発明の組成物には、従来から公知のシリコーンゴムやゲルなどの粉末、シリコーン変性エポキシ樹脂やシリコーン変性フェノール樹脂、メタクリル酸メチルーブタジエンースチレンよりなる熱可塑性樹脂などを低応力化剤として添加してもよい。なお、これら樹脂の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0030】また更に、任意成分としてシランカップリ

ング剤、チタン系カシプリング剤、アルミニウム系カップリング剤などのカップリング剤やカーボンブラックなどの着色剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、シリコーンオイルなどの濡れ向上剤や消泡剤なども場合によっては添加することができる。なお、これら任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0031】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、上記した諸原料を高速混合機などを用い、均一に混合した後、二本ロールや連続混練装置などで十分混練することにより製造することができる。混練温度としては、50~110℃が望ましい。混練後は、薄くシート化し、冷却、粉砕することでエポキシ樹脂組成物を製造することができる。

[0032]

【発明の効果】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、無機質充填剤として球状クリストバライトを特定量配合することにより、無機質充填剤を高充填化し得、かつ膨張係数の制御を簡単に行うこともでき、高熱伝導*

*化及び低吸水率で高品質の硬化物を与える。従って、本発明のエポキシ樹脂組成物は、半導体封止材料として最 先端デバイス用としても好適に利用することができる。 【0033】

10

【実施例】以下、調製例、実施例及び比較例を示し、本 発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制 限されるものではない。なお、下記の例において%はい

は、上記した諸原料を高速混合機などを用い、均一に混 【0034】 [調製例1] 表1に示す粒度分布を有する 合した後、二本ロールや連続混練装置などで十分混練す 10 球状溶融シリカを1500℃で20時間放置した後、毎 ることにより製造することができる。混練温度として 時100℃の割合で温度を下げ、25℃まで冷却した。

ずれも重量%、部は重量部を示す。

【0035】得られた球状クリストバライトを電子顕微鏡で測定し、形状を確認した後、粒度分布及びX線回折により結晶構造を確認した。粒度分布を表1に、X線回折を図1に、並びに、得られた球状クリストバライトと原料の球状溶融シリカの電子顕微鏡写真(倍率はいずれも1000倍)を図2に示す。

[0036]

【表1】

		原料球状溶融シリカ	本発明品 (球状クリストパライト)	
	96 μ 皿 以下	100.0	100.0	
	64 μ m 以下	95.8	96.7	
	48 μ m 以下	88.4	90.8	
粒度分布	24 μ m 以下	60.1	62.2	
(累積重量%)	12 μ 皿以下	39.9	42.9	
	6μm以下	22.5	25.8	
	3μm以下	13.3	14.2	
	1.5 μ 皿以下	. 4.4	5.6	
平均粒	(连 (μ m)	17.3	16.2	
I	其比重	2.2	2.36	
上表面	隨 (m²/g)	0.9	1.0	
抽出不純物	アルカリ金属イオン	カリ金属イオン 9 8	8	
(ppm)	ハロゲンイオン	12	10	

【0037】 [調製例2~6] 調製例1で使用した球状溶融シリカを使用し、表3に示す製造条件でクリストバライト化を行った。得られたシリカの物性を表3に併記する。

【0038】 [調製例7] 原料として表2に示す破砕溶 融シリカを使用し、表3に示す製造条件でクリストバライト化を行った。得られたシリカの物性を表3に併記する。

[0039]

12

12 µ m以下

βμm以下

3 µ m以下

1.5 µ m以下

比表面積 (m²/g)

粒度分布 (果積重量%)

39.9

22.5

13.3

17.3

2.2

0.9

*【0040】 【表3】

10

*

翻製例 7 1300 1600 1500 1000 800 1500 最高温度 (℃) 20 加熱時間(時間) 40 15 20 40 50 真比重 2.33 2.35 2.34 2.32 2.20 2.31 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 比表面積 (m²/g) 1.0 クリスト パライト クリストバライト 無定型 X線回折 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96 µ m以下 96.2 96.8 97.2 96.3 95.7 95.7 64 µ m以下 87.2 48 µ m以下 86.4 85.2 85.4 88.1 87.9 61.5 24 µ m以下 62.3 63.5 65.2 61.2 61.2 粒度分布 (累積重量%) 38.6 37.9 36.8 38.2 40.1 42.0 12 µ m以下 21.9 23.4 26.4 23.8 6μm以下 23.4 24.1 14.2 13.9 13.4 12.1 13.9 14.2 3 μ 皿以下 4.0 5.2 4.9 5.5 4.9 4.4 1.5 µ m 以下

球状

球状

球状

球状

【0041】 [実施例1~4、比較例1,2] エポキシ 樹脂としてYX4000 (油化シェル製)43.2 部、 硬化剤としてミレックス (三井化学製)51.8 部、臭素化エポキシ樹脂としてBREN-S (日本化薬製)5 部、表4に示す種類及び量の無機質充填剤、三酸化アンチモン5部、着色剤としてカーボンブラック1.5 部、シランカップリング剤としてKBM403 (信越化学製)1.0 部、離型剤としてカルナバワックス1.2

形状

部、触媒としてトリフェニルホスフィン(北興化学製) 0.8部を秤取り、高速混合装置で10分間混合撹拌した後、連続押し出し機で混練することでエポキシ樹脂組成物を得た。

破砕状

球状

【0042】得られエポキシ樹脂組成物につき下記の諸物性を測定した。結果を表4,5に示す。

スパイラルフロー:成形温度175℃、成形温度70k 50 g/c m²でトランスファー成形することでスパイラル フローを測定した。

ゲル化時間:175℃の熱板でエポキシ樹脂組成物がゲルになるまでの時間を測定した。

溶融粘度:高化式フローテスターを用い、10kgの加圧下、直径1mmのノズルを用い、温度175℃で粘度を測定した。

ガラス転移温度、膨張係数: 175℃、70kg/cm²、成形時間2分の条件で4×4×15mmの試験片を成形し、180℃で4時間ポストキュアーしたものを用い、ディラトメーターにより5℃/分で昇温させること 10により測定した。

吸水率:175℃、70kg/cm²、成形時間2分の 条件で直径50×3mmの円盤を成形し、180℃で4 時間ポストキュアーしたものを85℃/85%RH雰囲* *気中に72時間放置し、吸水率を測定した。

吸湿後の耐クラック性:銅フレームの100ピンQFP 用リードフレーム(形状 $14\times20\times2$.7mm)に 6. 5×6 .5mmの大きさのチップを搭載し、実施例 1,2,4、比較例1,2で得たエポキシ樹脂組成物で 封止した。封止条件はいずれも175℃、成形条件70kg/cm²、成形時間2分で行い、ポストキュアーは 180℃で4時間行った。それぞれの樹脂組成物で封止 したパッケージ5個を85℃/85%RH雰囲気中に72時間放置、吸湿させた後、ピーク温度240℃のIR リフローを3回通し、耐ハンダリフロー性を評価した。

14

[0043]

【表4】

			実施	5例		比意	2例
		1	2	3	4	1	2
	種類	関製例1 (あ状のク リストパ ライト)	関製例2 (取状のク リストバ ライト)	開製例3 (球状のク リストバ ライト)	関係のク 切状のク リストバ ライト)	実施)6 (無定型 シリカ)	開発例7 (使路状の クリスト バライト)
無機	配合量(部)	100	225	125	530	225	225
無機質充填剤	種類	関製例1 の原料球 状溶験シ リカ	関製例1 の原料球 状溶融シ リカ	球状アル ミナ	関製例1 の原料球 状落融シ リカ	関製例1 の原料球 状容融シ リカ	関製例1 の原料球 状溶融シ リカ
	配合量(部)	800	675	775	370	675	675
スパイラル	/フロー (cm)	115	109	95	120	104	38
ゲル化時間	ゲル化時間(秒)		24	25	23	25	20
溶融粘度	溶融粘度 (ポイズ)		105	150	124	130	720
成形硬度	成形硬度		65	72	65	61	58
ガラス転移	·温度 (℃)	120	124	119	121	125	123
膨張係数	膨張係数 (ppm)		12	17	17	10	12
吸水率(9	吸水率(%)		0.08	0.06	0.07	0.08	0.09

[0044]

※ ※【表5】

		85℃/85 % RH/72時間放置後 IR リフロー		
		内部クラック	外部クラック	
実施例	1	0/10	0/10	
	2	0/10	0/10	
	4	0/10	0/10	
比較例	1	5/10	0/10	
	2	粘度が高すぎてダイパッドシフトが起こり評価できず。		

【図面の簡単な説明】

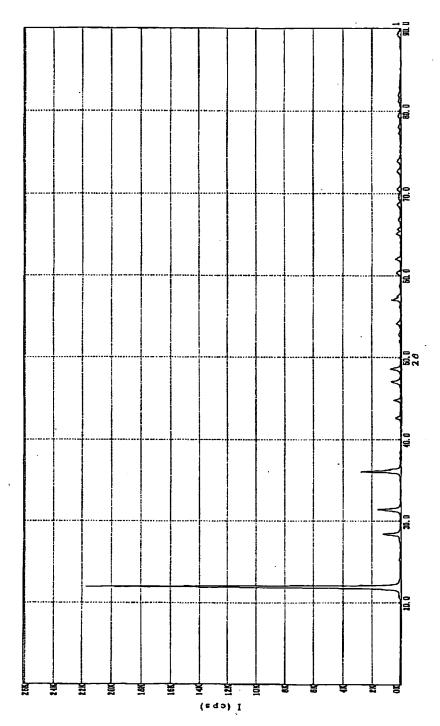
線回折を示すグラフである。

【図1】調製例1で得られた球状クリストバライトのX 50 【図2】(A)は調製例1で得られた球状クリストバラ

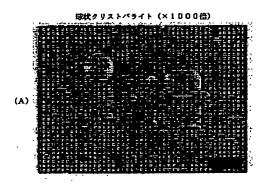
・ イト及び(B)は原料の球状溶融シリカの電子顕微鏡写 真(倍率はそれぞれ1000倍)である。

16

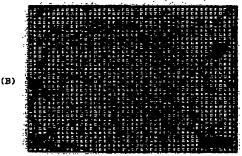
【図1】



【図2】



原料球状溶酸シリカ(×1000倍)



【手続補正書】

【提出日】平成11年4月23日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】本発明の硬化剤としては、1分子中にフェ ノール性の水酸基を2個以上有するフェノール樹脂であ れば如何なるものでも使用可能である。具体的には、フ ェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂等 のノボラック型フェノール樹脂、フェノールアラルキル 樹脂、トリフェノールアルカン型樹脂、ナフタレン型フ ェノール樹脂、ビフェニル型樹脂、シクロペンタジエン 型フェノール樹脂や下記構造のフェノー性水酸基を含有 するものなどが例示される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正内容】

【0042】得られエポキシ樹脂組成物につき下記の諸 物性を測定した。結果を表4,5に示す。

スパイラルフロー:成形温度175℃、成形温度70k

gf/cm²でトランスファー成形することでスパイラ ルフローを測定した。

ゲル化時間:175℃の熱板でエポキシ樹脂組成物がゲ ルになるまでの時間を測定した。

溶融粘度: 高化式フローテスターを用い、10kgの加 圧下、直径1mmのノズルを用い、温度175℃で粘度 を測定した。

ガラス転移温度、膨張係数:175℃、70kgf/c m²、成形時間2分の条件で4×4×15mmの試験片 を成形し、180℃で4時間ポストキュアーしたものを 用い、ディラトメーターにより5℃/分で昇温させるこ とにより測定した。

吸水率:175℃、70kgf/cm²、成形時間2分 の条件で直径50×3mmの円盤を成形し、180℃で 4時間ポストキュアーしたものを85℃/85%RH雰 囲気中に72時間放置し、吸水率を測定した。

吸湿後の耐クラック性: 銅フレームの100ピンQFP 用リードフレーム (形状14×20×2.7mm) に 6. 5×6. 5mmの大きさのチップを搭載し、実施例 1, 2, 4、比較例1, 2で得たエポキシ樹脂組成物で 封止した。封止条件はいずれも175℃、成形条件70 kgf/cm²、成形時間2分で行い、ポストキュアー は180℃で4時間行った。それぞれの樹脂組成物で封 止したパッケージ5個を85℃/85%RH雰囲気中に 72時間放置、吸湿させた後、ピーク温度240℃のI Rリフローを3回通し、耐ハンダリフロー性を評価した。

フロントページの続き

(72) 発明者 塩原 利夫

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内 (72)発明者 青木 貴之

群馬県碓氷郡松井田町大字人見 1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

(72)発明者 長田 将一 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内